

【 併設展示会 : 出展製品 】

BeCu合金製 真空配管および、チャンバー

0.2% BeCu 合金で自らのアウトガスを極力抑えた魔法の真空構造材！
熱源部分などのアウトガスに対するソリューション！



超低ガス放出残留ガス分析計 WATMASS

10⁻¹³Pa 台の高精度なガス分析が可能



極高真空計

3Bゲージ

X線限界10⁻¹²Pa の測定が
可能なイオンゲージ



大電カマグネトロンスパッタリング

HiPIMS電源

アーク異常放電を抑制する
成膜レートをアップする

HiPIMS
for
**high quality
sputtering**



NEGポンプ Magic NEG

極高真空発生
NEG ポンプ



【 講演 】

1件目:講演番号 2Gp08S

講演タイトル:バイポーラHiPIMS法を用いたDLC成膜におけるアーキング特性に及ぼすパルス幅依存性

発表者:岡山理大院工1, 東京電子2, 岡山工技セ3, ケニックス4, 岡山理大フロンティア研5

○福江紘幸1, 岡野忠之2, 黒岩雅英2, 國次真輔3, 太田裕己4, 米澤健4, 中谷達行5

2件目:講演番号 2P23

講演タイトル:大強度陽子加速器におけるビームラインの圧力挙動

発表者:東京電子株式会社 和田 薫

日本原子力研究開発 神谷 潤一郎(共著者)

発表形式:ポスター

【 ランチオンセミナー 】

日時 : 決定次第、発表

場所 : 決定次第、発表

テーマ : 1) スパッタ時の不良の原因であるアーク異常放電、この問題を高周波パルスで解決させる「アーク抑制型 HiPIMS 用パルス電源」の紹介

2) MEMS などの封止デバイスの超微量リークを検知
 10^{-15} Pa m³/s (He) という世界初の値を実現!
それを実現させる BeCu 材の紹介